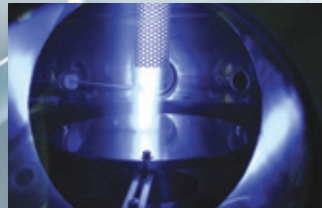




イソラスト PureFab™ JPF20



高い耐プラズマ性を備えた過酷な半導体製造プロセス用途向け材料

イソラスト PureFab™ JPF20は、酸素プラズマとフッ素系プラズマへの優れた耐性、さらにラジカルやイオンリッチプラズマへの耐性も備えたパーフロロエラストマー材料です。

最も過酷なプロセスやアプリケーション下であっても、最高クラスのシール性能を発揮できるよう、完全にフッ素化されたポリマー主鎖と独自の架橋技術によって構成された材料となっています。ナノレベルのフィラー充填により、イソラスト PureFab™ JPF20は、パーティクル発生を最小化させながら大変優れた耐プラズマ性を実現した材料となっています。

連続動作温度は、最高+300 °C/(+572 °F) となっています。この高温特性に加え、金属溶出も極微量であることから、過酷なエッチング用途に適した材料となっています。

特長

- ナノレベルでのフィラー充填による、攻撃性の高いイオンやラジカル リッチ プラズマに対する優れた耐性
- フィラー充填量を低くした先進のエラストマー組成により、パーティクル発生を極小化
- 優れた高温安定性により、過酷な用途にも使用可能
- 連続動作温度: ~+300 °C/(+572 °F)

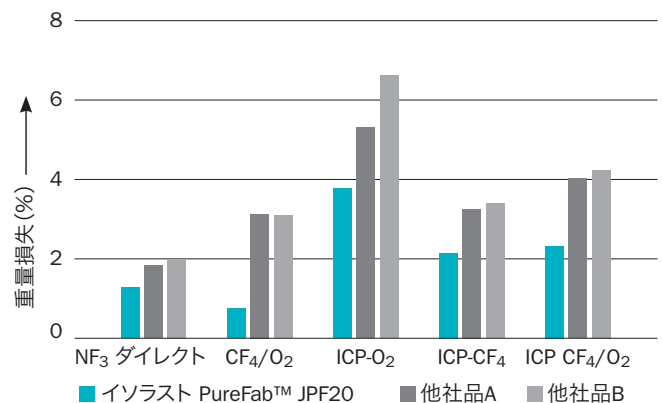
主な用途

- エッチプロセス: ドライエッチ、ALE、絶縁膜エッチング
- チャンバーのリッドシール
- プラズマシャワーヘッドやプラズマ導入管のシール
- スリットバルブのドア用シール

耐プラズマ性

下記の試験結果から、他社製品よりもイソラスト PureFab™ JPF20は、重量損失が低く、優れた耐プラズマ性を示します。

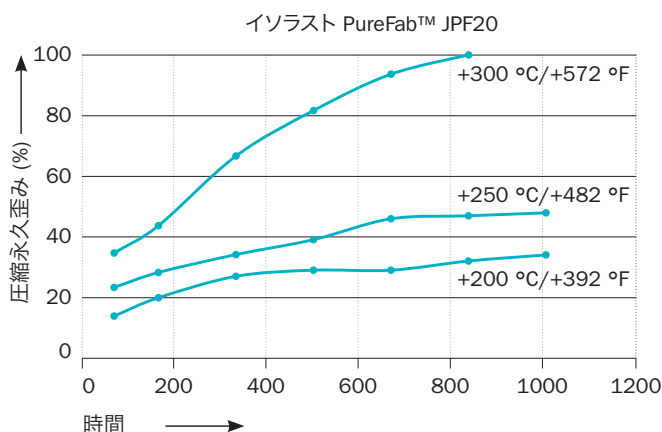
プラズマ照射による重量損失 (%)



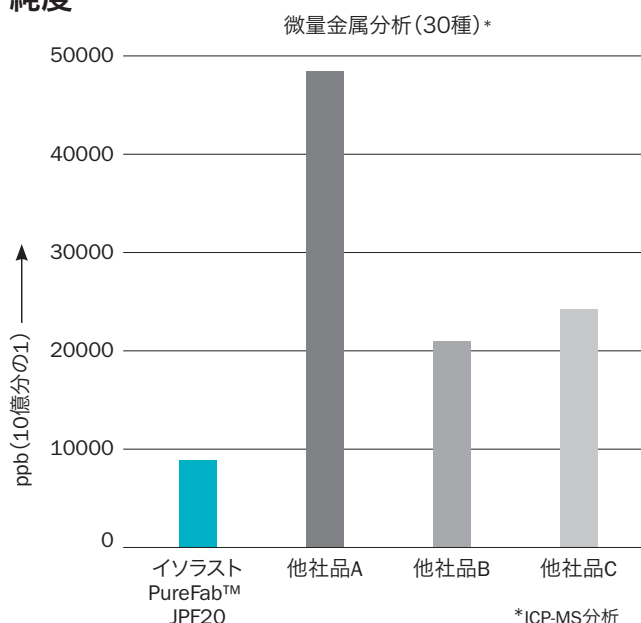
一般データ	JPF20
エラストマータイプ	FFKM
色	灰色

パラメータ	試験方法	結果
硬さ (Shore A)	D2240	68
引張り強さ (MPa)	D1414	10.3
破断伸び (%)	D1414	265
100%モジュラス (MPa)	D1414	1.75
圧縮永久歪み (%)		
72h @+200 °C/+392 °F		14
72h @+250 °C/+482 °F	D395	23
72h @+300 °C/+572 °F		35
連続運転時の最高使用温度		~+300 °C/(+572 °F)

圧縮永久歪み



純度



トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、数十年にわたるエンジニアリングとアプリケーションの経験に加えて、過酷な半導体製造プロセス向けの高精度でカスタマイズされたシール製品の設計に関する最新の知識を提供します。

イソラスト PureFab™ シリーズは、プラズマや高温環境下において最高クラスの高純度をほこるシール性能を実現し、プロセス薬品、アプリケーション、複雑な半導体製造プロセスの要求項目にお応えするため、用途ごとに独自の材料をそろえています。

各国ごとの営業員と半導体業界専門の社員、そしてグローバルでのサポートという3つの柱により、設計、試作品提供、そして量産にいたるまでシール業界トップクラスのサービスを提供いたします。このサービス体制に加え、様々なデジタルツールを提供しており、お客様の業務効率向上に貢献しています。



詳細な情報やご連絡先については上記のQRコードをスキャンいただくか下記弊社Webサイトをご覧ください。
WWW.TRELLEBORG.COM/SEALS/JP



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/SEALS/JP

日本トレルボルグ シーリング ソリューションズ 株式会社

東京:03-5633-8008 大阪:06-6821-0077 名古屋:052-212-5731